【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【公開番号】特開2019-75520(P2019-75520A)
【公開日】令和1年5月16日(2019.5.16)
【年通号数】公開・登録公報2019-018
【出願番号】特願2017-202620(P2017-202620)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/304　(2006.01)
Ｂ２４Ｂ　37/013　(2012.01)
Ｂ２４Ｂ　49/12　(2006.01)
Ｂ２４Ｂ　57/00　(2006.01)
Ｇ０１Ｂ　11/06　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２２Ｓ
Ｈ０１Ｌ　21/304　６２２Ｅ
Ｂ２４Ｂ　37/013
Ｂ２４Ｂ　49/12
Ｂ２４Ｂ　57/00
Ｇ０１Ｂ　11/06　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月15日(2020.10.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
前記流体供給制御装置は、前記決定された距離が前記所定の範囲内に入って、前記流体の供給を開始した時から、所定の期間は、第１の供給量で前記流体を供給し、前記所定の期間が経過した後は、第１の供給量より少ない第２の供給量で前記流体を供給することを特徴とする請求項４または５記載の研磨装置。